

セラミックディフューザ

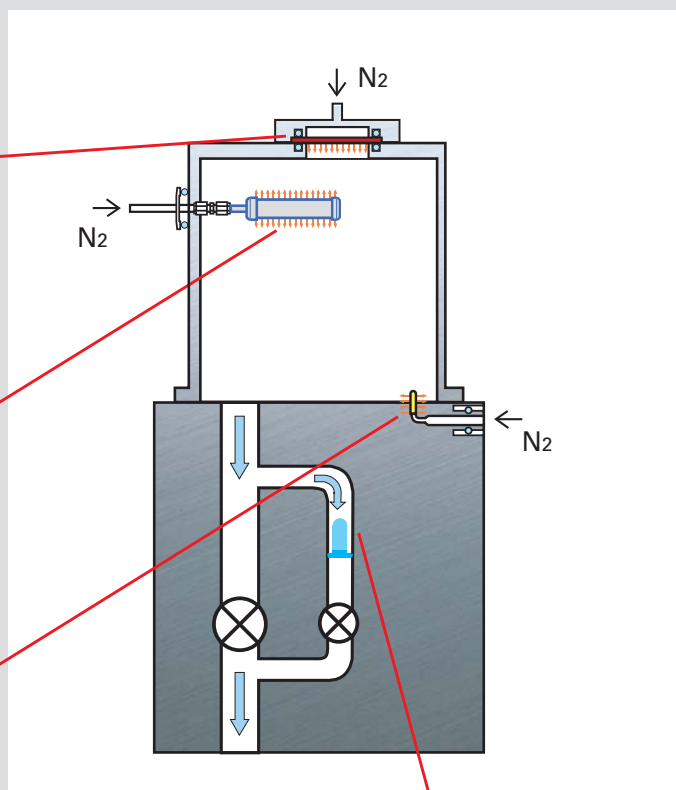
Ceramic Diffuser

真空装置のパーティクル低減、スループット向上 Particle reduction and improved throughput in vacuum equipment

真空破壊用(真空から大気圧へ) For vacuum break use (From vacuum to atmospheric pressure)

- ・真空破壊時のパーティクル舞い上がり防止
Particle spread is prevented at the time of vacuum break
- ・真空破壊時間の短縮
Venting time is shortened

- ・チャンバー内の省スペース化(板状SiCタイプ)
Minimal space in a chamber (Disk shaped SiC VBF)
- ・プロセスチャンバーで使用可能(オール石英タイプ)
Can be installed in a process chambers (Quartz glass VBF)



真空排気用(大気圧から真空へ) For vacuum use (From atmospheric pressure to vacuum)

- ・真空排気時のパーティクル舞い上がり防止
Particle spread is prevented at the time of vacuum
- ・真空排気時間の短縮
Vacuum time is shortened
- ・既存設備に設置可能
Can be installed on existing equipment
- ・プロセスチャンバーで使用可能(オール石英タイプ)
Can be installed in a process chambers (Quartz glass type)



COVALENT

コバレントマテリアル株式会社

セラミックス事業本部

東京都品川区大崎1-6-3 日精ビルディング 〒141-0032

Tel:03-5437-8409 Fax:03-5437-7395 E-mail:covalent_filter@covalent.co.jp

www.covalent.co.jp